Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

188/03 **ПРИКАЗ** 01.03.2021

Екатеринбург

О закреплении оборудования за УЦКП СН УрФУ

В целях улучшения, укрепления и развития материально-технической базы научных исследований, обеспечения потребности Уральского федерального университета, институтов Уральского отделения РАН и других организаций Уральского региона в проведении фундаментальных и прикладных научных работ в области физического материаловедения, разработки технологий получения перспективных материалов на оборудовании, соответствующем мировому уровню, а также для концентрации финансовых и инженерных ресурсов для приобретения и обслуживания указанного оборудования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень современного уникального научного и технологического оборудования для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области нанотехнологий, используемого УЦКП СН (Приложение 1).
2. Отменить действие п.1 приказа ректора от 17 апреля 2018 г. №364/03
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по науке Германенко А.В.

Ректор В.А. Кокшаров

ПРОРЕКТОР ПО НАУКЕ
А.В.ГЕРМАНЕНКО

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Приказом ректора
от 01.03.2021 № 188/03

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
для закрепления за УЦКП «Современные нанотехнологии»

№	Наименование единицы оборудования	Фирма изготовитель, страна, год выпуска	Ответственное лицо	Комната №
	Аналитическое оборудование - Микроскопия			
1.	Комплекс оборудования сканирующей зондовой микроскопии			
	Зондовая нанолаборатория NTEGRA-Aura	ЗАО «НТ-МДТ», Россия, 2007	Шур В.Я.	109
	Зондовая нанолаборатория NTEGRA-Therma	ЗАО «НТ-МДТ», Россия, 2007	Шур В.Я.	109
	Зондовая нанолаборатория NTEGRA-Prima	ЗАО «НТ-МДТ», Россия, 2007	Шур В.Я.	124
	Сканирующий зондовый микроскоп MFP 3D SA	Asylum Research, США, 2013	Шур В.Я.	126
	Сканирующий зондовый микроскоп-нанотвердомер НаноСкан-4Д	ФГБНУ ТИСНУМ, Россия	Шур В.Я.	109
2.	Комплекс оборудования конфокальной микроскопии			
	Зондовая нанолаборатория NTEGRA-Spectra	ЗАО «НТ-МДТ», Россия, 2007	Шур В.Я.	109
	Система конфокальной микроскопии комбинационного рассеяния Alpha 300 AR	WiTec, Германия, 2012	Шур В.Я.	122
3.	Комплекс оборудования электронной микроскопии			
	Аналитический комплекс для исследований химических и физических свойств материалов с системой для подготовки образцов и улучшения контраста сканирующей электронной микроскопии и микроанализа Auriga CrossBeam	Carl Zeiss, Германия, 2010	Шур В.Я.	124
	Микроскоп электронный автоэмиссионный сканирующий Merlin	Carl Zeiss, Германия, 2016	Шур В.Я.	126
	Сканирующий электронный микроскоп EVO LS 10	Carl Zeiss, Германия, 2014	Шур В.Я.	113
	Микроскоп электронный сканирующий VEGA 3 SBH	Tescan, Чехия, 2020	Черепанов В.А.	116
4.	Комплекс оборудования оптической микроскопии			
	Моторизированный оптический микроскоп для материаловедения с системой автоматического панорамирования Olympus BX61TRF	Olympus, Япония, 2011	Шур В.Я.	126
	Оптический микроскоп Olympus BX-51 с системой фоторегистрации	Olympus, Япония, 2004	Шур В.Я.	229
	Оптический профилометр Wyko NT 1100	Veeco Instruments Inc, США, 2007	Шур В.Я.	229
	Двухкоординатная комбинированная система бесконтактных измерений Kestrel-200/Peregrine	Vision Engineering Великобритания, 2010	Шур В.Я.	231

	Аналитическое оборудование - Анализаторы			
5.	Комплекс оборудования для термического анализа			
	Прибор синхронного DCK/DTA термоанализатор STA 409 PC Luxx	Netzsh, Германия, 2007	Черепанов В.А.	417
	Прибор синхронного DCK/DTA термогравиметрический анализатор PYRIS 1 TGA	Perkin-Elmer, США, 2008	Анимица И.Е.	406
	Высокотемпературный дилатометр DIL 402C	Netzsh, Германия, 2007	Черепанов В.А.	318
	Анализатор площади поверхности и пористости TriStar 3000	Micromeritics, США, 2007	Вшивков С.А.	214
	Аналитическое оборудование - Спектрометрия			
6.	Комплекс оборудования для хромато-масс-спектрометрии			
	Хромато-масс-спектрометр гибридный квадрупольный Xevo QTof UPLC	Waters, США, 2010	Киселева И.С.	158а
	Газоаналитическая система на основе квадрупольного масс-спектрометра STA 409 Luxx/QMS 403 C	Netzsh, Германия, 2007	Анимица И.Е.	414
7.	Комплекс оборудования для определения состава материалов			
	Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой iCAP 6500 Duo	Thermo Scientific, США, 2007	Неудачина Л.К.	309
	Атомно-абсорбционный спектрометр Solaar 6M	Thermo Scientific, США, 2007	Неудачина Л.К.	309
	Хроматограф жидкостный LC-20AD	Shimadzu, Япония, 2008	Неудачина Л.К.	312
	Хроматограф газовый Thermo Focus GC	Thermo Scientific, Италия, 2008	Неудачина Л.К.	312
8.	Комплекс оборудования для оптической спектрометрии			
	ИК-Фурье спектрометр Nicolet 6700	Thermo Scientific, США, 2008	Неудачина Л.К.	307
	Спектрофлюориметр Флюорат-02-Панорама	Люмэкс, Россия, 2008	Неудачина Л.К.	307
	Двухлучевой прецизионный спектрофотометр Agilent Cary 5000	Agilent Technologies Inc., США, 2013	Шур В.Я.	126
9.	Комплекс оборудования для анализа состава поверхности			
	Рентгенофлуоресцентный спектрометр на полном внутреннем отражении Nanohunter	Rigaku Corp., Япония, 2010	Васьковский В.О.	284
	Спектрометр рентгеновский фотоэлектронный многофункциональный K-ALPHA	Thermo Fisher Scientific, Великобритания, 2015	Шур В.Я.	113
	Аналитическое оборудование – Магнитометрия			
10.	Комплекс оборудования для магнитометрии			
	СКВИД-магнитометр MPMS XL7	Quantum Design, США, 2008	Кудреватых Н.В.	278
	Магнитометр вибрационный 7407 VSM	Lake Shore Cryotronics, США, 2013	Кудреватых Н.В.	285
11.	Комплекс оборудования для магнитных измерений			
	Измеритель свойств постоянных магнитов Permagraf-L	Magnet Physik GmbH, Германия, 2012	Кудреватых Н.В.	283
	Магнитооптический Керр-микроскоп Evico	Evico magnetics, Германия, 2015	Васьковский В.О.	373

	Установка автоматизированная для измерения магнитокалорического эффекта MagEq MMS	ПМТиК, Россия, 2015	Васьковский В.О.	375
	Система специализированная измерения параметров PPMS Dyna Cool с опциями	Quantum Design Inc., США, 2016	Васьковский В.О.	169
	Спектрометр электронного парамагнитного и двойного электронно-ядерного резонансов EMX Plus	Bruker, Германия, 2007	Важенин В.А.	103
	Аналитическое оборудование – Прочее			
12.	Комплекс оборудования рентгеновской дифрактометрии			
	Дифрактометр порошковый рентгеновский XRD 7000S	Shimadzu, Япония, 2014	Черепанов В.А.	102в
	Дифрактометр рентгеновский порошковый EQUINOX 3000	INEL SAS, Франция, 2011	Черепанов В.А.	102в
13.	Комплекс оборудования измерения физических свойств материалов			
	Электромеханическая испытательная машина для исследования механических свойств материалов AG-50kNXD	Shimadzu, Япония, 2008	Баранов Н.В.	105
	Комплекс для измерения физических свойств материалов DMS-1000	Dryogenic, Англия, 2008	Баранов Н.В.	100
14.	Комплекс оборудования для исследования сегнетоэлектрических материалов			
	Многофункциональная система для измерения и анализа свойств сегнето, пиро, диэлектриков aixPES	aixACCT Systems GmbH, Германия, 2012	Шур В.Я.	215
	Оптический микроскоп с системой для высокоскоростной видеосъемки Olympus BX-61; FC13	Olympus, Япония, 2011 FastVision, США, 2007	Шур В.Я.	229
	Интерферометрический измерительный комплекс Thorlabs	Thorlabs, США 2014	Шур В.Я.	06
	Технологическое оборудование			
15.	Комплекс оборудования для фотолитографии			
	Чистое производственное помещение класса ГОСТ ИСО5	СК РОСТ, Россия, 2007	Шур В.Я.	213
	Установка для нанесения и термической обработки резиста Sawatec SM180-HP250HDMS	Sawatec Solutions, Лихтенштейн, 2008	Шур В.Я.	213
	Установка совмещения фотошаблона и пластины SUSS MJB4	Suss MicroTec, Германия, 2008	Шур В.Я.	213
	Установка для очистки пластин, проявки и удаления резиста OPTIwet St30	SSE, Германия, 2008	Шур В.Я.	213
	Система контроля качества фотолитографии Olympus BX-51	Olympus, Япония, 2018	Шур В.Я.	213
	Система очистки воды Elix 10	Millipore, Франция, 2007	Шур В.Я.	213
16.	Комплекс оборудования для нанесения тонких пленок			
	Комплект вакуумной установки для электронно-лучевого испарения и магнетронного напыления Auto 500 Edwards	BOC Edw., Великобритания, 2008	Шур В.Я.	222
	Комплект вакуумной установки магнетронного распыления ATC Orion 8 UHV	AJA Int. Inc., США, 2008	Васьковский В.О.	275

	Установка реактивно-ионного травления Plasmalab 80 plus RIE	Oxford Instruments, Великобритания, 2008	Шур В.Я.	222
	Вакуумное технологическое оборудование ELATO	IZOVAC, Белорусь, 2016	Шур В.Я.	229
17.	Комплекс оборудования для измерения параметров лазерного излучения			
	Импульсный твердотельный лазер с гармониками Brilliant	Quantel, Франция, 2007	Шур В.Я.	220
	Лазерная система для обработки материалов на базе CO_2 лазера VL-300/40	ЦЛТ, Россия, 2008	Шур В.Я.	101
	Система FX50 BeamStar	Ophir, Израиль, 2007	Шур В.Я.	220
18.	Комплекс оборудования для синтеза коллоидных растворов наночастиц металлов			
	Система прецизионной лазерной маркировки МиниМаркер 2 - М20	ООО «Лазерный центр», Россия, 2017	Шур В.Я.	101
	Лазерная система для обработки материалов на базе волоконного лазера Fmark-20	ЦЛТ, Россия, 2008	Шур В.Я.	101
	Анализатор дисперсии наночастиц и растворов универсальный Zetasizer Nano	Malvern Instruments, Великобритания 2009	Шур В.Я.	101
	Анализатор размеров частиц SALD-7101	Shimadzu, Япония, 2007	Черепанов В.А.	412
	Камера инфракрасная H2640 (NEC)	NEC, Япония 2013	Шур В.Я.	101
19.	Комплекс оборудования для прецизионной механической обработки			
	Станок для прецизионной шлифовки и полировки PM5	Logitech, Великобритания, 2007	Шур В.Я.	231
	Алмазная дисковая и проволочная пила Model 15	Logitech, Великобритания, 2007	Шур В.Я.	231
	Автоматическая установка резки DAAD 3220	DISCO, Япония, 2014	Шур В.Я.	231
20.	Комплекс оборудования для термообработки материалов			
	Высокотемпературная печь LHT 01/17 D/P480	Nabertherm, Германия, 2019	Шур В.Я.	06
	Печь камерная LHT 08/18	Nabertherm, Германия,	Черепанов В.А.	08
	Муфельная электропечь ТК.8-1150.М.1Ф	ООО «НПО «Термокерамика», Россия, 2013	Шур В.Я.	06

СОГЛАСОВАНО СД
ВМЕСТЕ С ОСНОВНЫМ
ДОКУМЕНТОМ